

「2024년 산업맞춤형 전문기술인력 양성사업」
〈 디스플레이 측정·분석장비 실습 교육 계획(안) 〉

1

교육 개요

- 교육명 : 디스플레이 측정·분석장비 실습 교육(2차)
- 목적 : 디스플레이 공정에서 발생하는 불량을 분석하기 위한 측정 및 분석 기술과 광소자 전기적 특성, 광학적 특성 평가를 교육을 통해 현장에 적용이 가능하도록 실무중심의 디스플레이 측정분석 전문인력 양성
- 날짜 : 2024. 12. 3. (화) ~ 12. 5. (목) / 3일(20시간)
- 장소 : KETI 전북지역본부 교육실/인쇄전자평가실/잉크개발실 등
- 교육인원 : 재직자 대상 12명 내외
- 문의처: 한국전자기술연구원 김선하 063-219-0110, sunha@keti.re.kr
- 접수방법: 신청서 메일 접수 및 온라인 접수
(<https://forms.gle/F7wSj3bDpB3Ynd237>)

온라인신청 QR



2

교육 내용

- 주사전자현미경/주사탐침현미경 등 측정·분석 장비 이론 교육
- 전자현미경 표면/단면, 정량/정성 분석 실습
- 주사탐침현미경 표면거칠기 측정실습
- 전기적 특성 평가(Probe station) 실습 교육
- 기타 측정분석 장비 실습

□ 세부 교육 일정

구 분	교육일자	시 간	분	교육 내용	담당자	
디 스 플 레 이 측 정 분 석 장 비 실 습 교 육	12/3 (화)	10:00 ~ 12:00	120	<교육 오리엔테이션> - 사업소개 및 교육일정, 교육과정 안내 - 전북지역본부 소개 및 실습조 구성	최철호 팀장	
		12:00 ~ 13:00	60	중 식		
		13:00 ~ 17:00	240	<측정분석 장비 이론 교육> - 나노 측정분석 장비 개요 및 응용사례 (SEM, FIB, SPM 등)		
	12/4 (수)	09:00 ~ 12:00	180	<전자현미경(SEM) 장비 실습> - 소자 표면/단면분석 실습 (샘플 전처리 및 코팅, 샘플 분석)		
		12:00 ~ 13:00	60	중 식		
		13:00 ~ 17:00	240	<집속이온빔(FIB) 장비 실습> - 전자현미경 Align/Focus 실습 - 성분 정성/정량 분석(EDS)		
	12/5 (목)	09:00 ~ 12:00	180	<주사탐침현미경(SPM) 장비 실습> - 샘플 전처리 및 캔틸레버 장착 - 표면거칠기(Roughness) 측정 - 결과데이터 분석		
		12:00 ~ 13:00	60	중 식		
		13:00 ~ 17:00	240	<전기적 특성 평가 실습 교육> - Probe station 장비 활용 전기적 특성 분석 - 소자 IV 및 CV 측정 등		
		17:00 ~ 17:15	15	<교육평가 및 수료식> · 교육 평가 및 설문지 작성		김선하 연구원

※ 인원수에 따른 조편성을 통해 실습교육이 진행되며, 교육 일정 및 강사가 변동될 수 있음

4

장소 안내

□ 한국전자기술연구원 전북지역본부

- 주소: 전북특별자치도 전주시 덕진구 반릉로 111(전주 IC에서 10분거리)
- 교육실 : 본관동 1층 교육실

